

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 21 年 2 月 19 日 (2009.2.19)

【公表番号】特表 2008-527328 (P2008-527328A)
 【公表日】平成 20 年 7 月 24 日 (2008.7.24)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-029
 【出願番号】特願 2007-549436 (P2007-549436)
 【国際特許分類】

G 0 1 R 1/073 (2006.01)

G 0 1 R 31/26 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 1/073 E

G 0 1 R 31/26 J

H 0 1 L 21/66 B

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 12 月 22 日 (2008.12.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体ウェハ上に形成された複数のデバイスをテストする接触器であって、
 該接触器は、該デバイス上に形成されるパッドと接触するプローブアレイを備え、
 該プローブアレイは、該プローブアレイの開口部の周りに配置された連続的な D U T アレイを含み、

該開口部は、該プローブアレイが該パッドに接触するとき、少なくとも 1 つのデバイスの上にある、接触器であって、該連続的な D U T アレイは、該複数のデバイスのうちの隣接するデバイスの閉ループのパッドと接触するように配置され、

該開口部は、該デバイスの隣接する 1 つのデバイスの閉ループ内に配置された該デバイスのうちの少なくとも 1 つに対応し、

該連続的な D U T アレイは、該隣接するデバイスの閉ループ内に配置された該複数のデバイスのうちの少なくとも 1 つと接触することなしに、連続的なデバイスの閉ループのデバイスに接触するように構成された、接触器。

【請求項 2】

前記プローブアレイは、前記 D U T アレイに、少なくとも 1 つの追加的な開口部を含み、該追加的な開口部は、該プローブアレイが前記パッドと接触するとき、少なくとも 1 つのデバイスと相対する、請求項 1 に記載の接触器。

【請求項 3】

前記連続的な D U T アレイは、概ね環状のパターンを形成する、請求項 1 に記載の接触器。

【請求項 4】

前記 D U T アレイの前記開口部は、4 つの D U T アレイと境界を接する、請求項 1 に記載の接触器。

【請求項 5】

半導体ウェハ上に形成された複数のデバイスをテストする装置であって、

該装置は、少なくとも 1 つの開口部を含むパターンに配置されたプローブ D U T アレイを備え、

該少なくとも 1 つの開口部は、プローブ D U T アレイがない該パターンの周囲内に含まれ、

該 D U T アレイのパターンは、該複数のデバイスのパターンに対応し、

閉ループは、該複数のデバイスのうちの連続的なデバイスの閉ループに対応し、

該開口部は、該連続的なデバイスの閉ループ内に位置する該複数のデバイスのうちの少なくとも 1 つに対応し、

該プローブ D U T アレイは、該連続的なデバイスの閉ループ内に位置する該複数のデバイスのうちの少なくとも 1 つと接触することなしに、該連続的なデバイスの閉ループのデバイスに接触するように構成された、装置。

【請求項 6】

前記プローブアレイパターンは、少なくとも 1 つの追加的な開口部を含み、

該追加的な開口部は、プローブ D U T アレイがない該パターンの周囲内に含まれる、請求項 5 に記載の装置。

【請求項 7】

前記パターンは、概ね環状である、請求項 5 に記載の装置。

【請求項 8】

前記開口部は、4 つの D U T アレイと境界を接する、請求項 5 に記載の装置。